

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长兼总经理赫建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登了本次股东大会通知的公告(公告编号：2019-013)。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 96,082,000 股，占公司表决权股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举张利先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于李彬彬先生近期因个人原因辞任公司董事一职，为保证公司董事会工作顺利开

展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟提名选举张利先生担任公司董事会董事，其任职期限为自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2019-010）及《董事任命公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州市晶华精密光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2019年6月11日